

電気学会研究会資料目次

誘電・絶縁材料研究会

テーマ 「有機エレクトロニクス・一般」

〔委員長〕岡本達希（電中研）
〔幹事〕内田克巳（中部電力），宮下芳次（三菱電線工業）
〔幹事補佐〕岡下 稔（昭和電線），西川宏之（芝浦工大）

日時 平成15年1月20日（火）13:00～17:00

場所 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー（VBL）セミナー室（4階）（名古屋市千種区不老町，地下鉄東山線本山駅下車，徒歩15分，詳細は，<http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access/access.html> をご参照下さい）

- DEI-04-1 ホストゲスト薄膜により作成された光準導波路の光双安定特性
落合鎮康，小谷範幸，澤 五郎，内田悦行，大橋朝夫，小嶋憲三（愛知工大）..... 1
- DEI-04-2 Au(111) 面基板上に作成されたフタロシアニン薄膜の配向とフタロシアニン分子構造
濱口裕功，金 永龍，澤 五郎，内田悦行，大橋朝夫，小嶋憲三，落合鎮康（愛知工大）..... 7
- DEI-04-3 KBr 基板上に作成されたバナジルフタロシアニン単結晶膜の成長過程，成長機構，
非線形光学特性
南川亜有美，中野寛之，澤 五郎，内田悦行，大橋朝夫，小嶋憲三，落合鎮康（愛知工大）..... 13
- DEI-04-4 マイクロ波帯及び光領域におけるネマティック液晶材料複屈折 n_o ， n_e の測定
亀井利久，内海要三（防衛大）..... 19
- DEI-04-5 色素増感太陽電池の等価回路解析
金子昌弘，森 竜雄，水谷照吉（名大）..... 23
- DEI-04-6 Q-Mass Study on C-Au-S Film Formation by Co-operation Process of Plasma
CVD and Sputtering
Md. Abul Kashem, Shinzo Morita (Nagoya Univ.) 27
- DEI-04-7 プラズマCVD - スパッタリング共同によるC-Cu-S合成金属膜
水野将範，森田慎三（名大）..... 33

共催 電子情報通信学会 有機エレクトロニクス研究会